Closed field unbalanced magnetron sputtering system을 이용하여 중착한 CrZr-Si-N 박막의 고온 안정성과 내 마모 특성 연구

오승천¹, 김광석¹, 김범석¹, 이상율^{1*} (1) 한국항공대학교, 항공재료공학과

초 록: Closed field unbalanced magnetron sputtering 방법을 이용하여 CrZr-Si-N 박막을 증착하였다. Si Target power의 변화에 따라 박막을 증착하여 XRD, SEM, XPS, GDOES, AFM, XPS, Nanoindentation을 이용하여 박막의 미세구조, 성분분석, 표면 조도, 경도를 측정하였다. 500 ℃에서 annealing한 후 상온에서의 박막의 경도와 비교하였고, 상온과 500 ℃에서 마모 실험을 행한 후 마찰 계수를 측정하여 비교하였다. Cr_{39.4}Zr_{12.3}N_{48.3} 박막은 500 ℃ annealing 후 경도는 30 GPa에서 24 GPa로 감소하였고 마찰계수는 0.23에서 0.81로 약 4배 증가하였다. 500 ℃ annealing 후 Cr_{34.6}Zr_{10.6}-Si_{6.4}-N_{48.4} 박막의 경도는 30 GPa로 상온에서의 경도 32 GPa과 비슷하였고 500 ℃와 상 온에서 수행된 마모시험 결과는 500 ℃에서 마찰계수 0.43으로 상온 마모시험 결과와 거의 비슷한 결과를 보였다. 상온의 경우 Si 함량에 따른 기계적 특성 및 마모특성의 변화는 거의 없었다. 그러나 500 ℃ annealing 후 CrZi-Si-N 박막의 기계적 특성 및 마모특성의 변화는 거의 없었다. 그러나 내었다. 이러한 결과들을 통해 Si 첨가가 CrZrN 박막의 고온 안정성 향상에 기여함을 확인할 수 있었 다.

1. 서 론

이전 연구를 통해 32GPa의 높은 경도와 특히 약 0.2의 매우 낮은 마찰계수를 갖는 CrZrN 박막을 합성하였다.¹ 그러나 CrZrN 박막은 고온에서 쉽게 산화되는 Zr의 특성으로 인해 500℃ 에서도 쉽게 산화되어 고온 내산화 특성이 취약하였다.² 최근 CrN, TiN 과 같은 이원계 전이금속 질화물 박막에 Si를 첨가하여 고온 안정성과 기계적 특성을 향상시킨 Me-Si-N (Me=Cr,Ti,W,Ta,Zr,Mo)³⁻⁸ 박막에 관한 연구 결과가 보고되었다. 본 연구에서는 CrZrN 박막에 Si를 첨가하여 합성한 CrZrSiN 박막의 고온 내 산화 특성, 내 마모 특성을 조사하고 CrZrN 박막과 비교 분석하였다.

2. 본 론

본 연구에서는 Closed feild unbalanced magnetron sputtering 방법을 이용하여 CrZr-Si-N 박막 을 증착하였다. CrZr segment 타겟과(Cr:Zr=50:50) Si 타겟을 이용하여 Si 웨이퍼(100)와 질화된 AISI H13강 위에 virtical 방식으로 합성하였다. 챔버 내의 압력1.34×10⁻³Pa 미만까지 배기한 후 Ar(0.4 Pa) 과 N₂(0.12 Pa) 혼합 가스를 0.52Pa 로 일정하게 유지하여 주입하였다. CrZr 타겟에 Pulsed DC 1.0kW (frequency: 25kHz, duty: 70 %)로 고정하여 인가하였고 다양한 함량의 Si를 첨 가하기 위하여 Si 타겟에 Pulsed DC 0.4~1.0A(frequency: 20kHz, duty:50 %)를 인가하였다. 그 밖 의 공정조건 바이어스 전압, 타겟과 시편간 거리, 시편 온도, 시편 회전 속도는 -100V, 90cm, 15 0℃, 10rev./min.으로 유지하였다.

Si 타겟 인가전류의 변화에 따른 CrZr-Si-N 박막의 조성은 glow discharge optical emission spectroscopy (GDOES: LECO GDS 850A)을 통해 분석하였고 Si 함량 변화에 따른 박막의 미세구 조 변화는 XRD, SEM, XPS를 통해 분석하였다. XRD 회절 분석과 SEM 단면 사진 분석 결과 Si 함 량이 증가함에 따라 결정립이 미세해졌고 XPS 분석을 통해 비정질 Si₃N₄가 존재함을 확인하였다. Nanoindentation을 이용하여 CrZr-Si-N 박막의 경도 측정한 결과 32~33 GPa로 CrZrN 박막 (32GPa) 과 비교하여 거의 변화가 없음을 확인하였다. 500 ℃에서 annealing한 후 상온에서의 박막의 경도와 비교하였고, 상온과 500 ℃에서 마모 실험을 통해 얻어진 마찰계수를 비교하였다. Cr_{39.4}Zr_{12.3}N_{48.3} 박막은 500 ℃ annealing 후 경도는 30 GPa에 서 24 GPa로 감소하였고 마찰계수는 0.23에서 0.81로 약 4배 증가하였다. 500 ℃ annealing 후 Cr_{34.6}Zr_{10.6}-Si_{6.4}-N_{48.4} 박막의 경도는 30 GPa로 상온에서의 경도 32 GPa과 비슷하였고 500 ℃와 상 온에서 수행된 마모시험 결과는 500 ℃에서 마찰계수0.43로 상온 마모시험 결과와 거의 비슷한 결과 를 보였다.

3. 결 론

1. 본 연구에서는 CFUBMS방법을 이용하여 Si 함량에 따른 CrZr-Si-N 박막을 성공적으로 합성하였 다.

2. CrZr-Si-N박막의 XRD 분석결과 Si 함량이 증가함에 따라 결정립의 크기가 감소함을 확인하였고 XRD 피크에서 나타나지 않은 비정질 Si₃N₄의 존재를 XPS 분석결과를 통해서 확인하였다.

3. 상온에서 CrZr-Si-N 박막의 경도와 마모특성은 Si 함량에 상관없이 비슷한 결과를 보였다. 모든 박막은 32~33 GPa의 높은 경도를 나타내었을 뿐만 아니라 0.22~0.23의 낮은 마찰계수를 나타내었 다. 그러나 500 ℃에서 annealing한 박막의 고온 안전성과 고온마모특성은 Si 함량에 크게 영향을 받 는 것으로 나타났다.

4. 500 ℃에서 annealing한 후, Cr_{39.4}Zr_{12.3}N_{48.3} 박막의 경도는 24 GPa로 크게 감소하였지만 Cr_{34.6}Zr_{10.6}-Si_{6.4}-N_{48.4} 박막의 경도는 30 GPa로 확인되었는데 이는 상온에서 합성된 박막의 경도(32 GPa)와 거의 유사하였다. 500 ℃에서의 마모실험에서 얻어진 Cr_{39.4}Zr_{12.3}N_{48.3} 마찰계수는 약 0.81로 써 상온에서의 마찰계수 0.23보다 약 4배 증가하였지만 500에서의 마모실험에서 얻어진 Cr_{34.6}Zr_{10.6}-Si_{6.4}-N_{48.4}의 마찰계수는 0.43으로 상온에서 얻어진 마찰계수보다 약 2배 증가하였다. 이 러한 결과들을 통해 Si 첨가가 CrZrN 박막의 고온 안정성 향상에 기여함을 확인할 수 있었다.

참고문헌

- G.S. Kim, B.S.Kim, S.Y.Lee, J.H.Hahn, "Structure and mechanical properties of Cr-Zr-N films synthesized by closed field unbalanced magnetron sputtering with vertical magnetron sources", Surf. Coat. Technol. 200,(2005),1669-1675.
- [2] S.M. Kim, B.S. Kim, G.S. Kim, S.Y. Lee, B.Y. Lee, "Evaluation of the high temperature characteristics of the CrZrN coatings", Surf. Coat. Technol. 202, (2008),5521–5525.
- [3] E. Martinez, R. Sanjinés, A. Karimi, J. Esteve, F. Lévy, "Mechanical properties of nanocomposite and multilayered Cr–Si–N sputtered thin films", Surf. Coat. Technol. 180–181,(2004),570.
- [4] S. Veprek, S. Reiprich, "A concept for the design of novel superhard coatings", Thin Solid Films 268,(1995),64.
- [5] J. Musil, R. Daniel, J. Soldán, P. Zeman, "Properties of reactively sputtered W-Si-N films" Surf. Coat. Technol. 200,(2006),3886.
- [6] J.W. Nah, W.S. Choi, S.K. Hwang, C.M. Lee, "Chemical state of (Ta, Si)N reactively sputtered coating on a high-speed steel substrate", Surf. Coat. Technol. 123,(2000),1.
- [7] R. Daniel, J. Musil, P. Zeman, C. Mitterer, "Thermal stability of magnetron sputtered Zr-Si-N films", Surf. Coat. Technol. 201,(2006),3368.
- [8] Q. Liu, Q.F. Fang, F.J. Liang, J.X. Wang, J.F. Yang, C. Li, "Synthesis and properties of nanocomposite MoSiN hard films", Surf. Coat. Technol. 201,(2006),1894.